

主催： 応用物理学会 / 日本光学会 / 微小光学研究グループ
電子情報通信学会 / エレクトロニクスソサイエティ / システムフォトニクス時限研究専門委員会

第 83 回微小光学・第 2 回システムフォトニクス 合同研究会

M E M S - フォトニクスへの新展開 -

日時： 2002 年 3 月 7 日 (木) 10:20~17:00
場所： NTT 武蔵野研究開発センター プレゼンテーションホール

(東京都武蔵野市緑町 3-9-11)

交通： JR 中央線三鷹駅北口バス乗場より

- ・ 1 番乗場から、「北裏」か「武蔵関」行に乗車。
「武蔵野市役所前」下車，徒歩 5 分。(計 15 分)
- ・ 2 番乗場から、「東伏見」か「柳沢駅」行に乗車。
「武蔵野住宅前」下車，徒歩 5 分。(計 15 分)
- ・ 5 番乗場から、「電気通信研究所」行に乗車。
「研究所正門前」下車。(計 10 分)
西武新宿線東伏見駅南口より徒歩 15 分



プログラム：

10:20-10:30	開会の挨拶	
10:30-11:30	【基調講演】光 MEMS 技術の現状と展望	藤田博之 (東大)
11:30-12:00	フォトリソグラフィ技術の動向	吉田英二 (NTT)
12:00-12:30	ビーム偏向型光スイッチの光学系に関する解析	岡山秀彰 (沖電気)
12:30-13:30	昼食休憩(60 分)	
13:30-14:00	マイクロマシンによる波長可変光デバイス	小山二三夫 (東工大)
14:00-14:30	Optically pumped MEMS based tunable VCSEL for telecom applications	D. Vakhshoori (CoreTek)
14:30-15:00	MEMS ファンドリーサービスの動向	原田宗生 (住友金属工業株式会社)
15:00-15:20	休憩(20 分)	
15:20-15:50	格子歪みを利用した 3 次元微細構造作製技術	久保田和芳 (ATR)
15:50-16:20	光マイクロマシンデバイス	澤田廉士 (NTT)
16:20-16:50	The Grating Light Valve Technology	A. Tomita (Cypress)
16:50-17:00	閉会の挨拶	

参加費：一般 4000 円，学生 1000 円 (資料代を含む) 当日ご持参ください。

参加申込：不要 (直接会場にお越しください)

担当委員：微小光学 中島啓幾(早稲田大)，横森清(リコー)，森(コニカ)，上西(NTT)，宮本(東工大)
システムフォトニクス 河合滋(職能大)，久々津直哉(NTT)，津田(慶應)，守谷(CRL)

問合せ先：東京工業大学精密工学研究所 宮本智之，TEL/FAX045-924-5059 tmiyamot@pi.titech.ac.jp

NTT 通信エネルギー研究所 久々津直哉 TEL046-240-2078,FAX046-240-4219 kukutsu@aecl.ntt.co.jp

プログラムは微小光学研究グループのホームページ (<http://www.din.or.jp/~microopt/>) でもご覧いただけます。